

NX-2500整片基板带对准可多层次纳米压印系统经过了大量的实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定。具备全部压印模式：热固化、紫外固化和压印。基于独特专利保护的Nanonex气垫软压技术（ACP），不论模版或基板背面粗糙程度如何，或是模版或基板表面波浪和弧形结构，**NX-2500**均可对其校正补偿从而获得无与伦比的压印均匀性，ACP消除了基板与模版之间侧向偏移，有效地延长了模版使用寿命。通过微小热容设计可获得快速的热压印周期，最终得到快速的工艺循环。

主要特点

所有形式的纳米压印

- 热塑化
- 紫外固化
- 热压与紫外压印同时进行
- 热固化

气垫软压技术(ACP)

- Nanonex专利技术
- 完美的整片基板纳米压印均匀性
- 高通量

低于10nm分辨率

亚1微米对准精度

快速工艺循环时间（小于60秒）

灵活性

- 4", 6", or 8"压印面积可选
- 各种尺寸及不规则形状模版与基板均可压印
- 方便用户操作

基于超过12年、15代产品开发经验的自动化压印操作

Nanonex压印系统经过大量实时实地验证，质量可靠，性能优越稳定

全自动纳米压印



NX-2500 多功能整片基板带对准功能
多层次的纳米压印系统

纳米压印系统参数

热塑压印模块

- 温度范围0~250°C
- 加热速度>300°C/分钟
- 制冷速度>150°C/分钟
- 压力范围0 ~ 3.8 MPa (550 psi)

紫外固化模块

- 200W窄带紫外光源
- 365纳米或395纳米波长可选
- 全自动化控制

对准模块

- <1μm 3σ对准准确率
- X, Y, Z, Theta平台
- 分场光学和CCD相机

模版装载功能

- 4"/5"/6"模版可用于标配纳米压印系统
- 8"模版可升级

基板装载

- 标配纳米压印系统可装载4"基板
- 6"和8"基板可选
- 各种尺寸及不规则形状模版及基板均可压印
- 独特专利保护ACP技术可最大限度保护基板和模版，特别对于象磷化铟（InP）等极易碎模版和基板给予最大限度保护。

其他参数

配有微软Windows的电脑控制系统
用户友好的控制软件

程序化控制压印温度、压力和时间
真空和压缩空气操作由电脑控制

手动装载/拆卸基板

全自动化压印操作

设备占地面积：31" × 66"
(787 mm × 1676 mm)

应用领域：纳米电子和光电子、显示器、数据存储介质、先进材料、生物科技、纳米流道等